

電子光学設計技術研究部会
責任者氏名 小瀬 洋一

皆様にはますます御健勝のこととお慶び申し上げます。

今日、多極子を用いた収差補正技術は実用化、高性能化され電子顕微鏡の高分解能化、分析高感度化に大いに貢献していることは周知の通りです。一方で、円環レンズやミラー電極による収差補正の新技术が提案されています。今回は、第60回シンポジウムに併設して、次世代の高性能、あるいは低コストで使い勝手の良い収差補正技術について議論する第6回研究会を開催します。

皆様のご参加、ご議論をお待ちしております。

(日時) 2017年11月30日(木) 9:00-12:00

(場所) ニューウェルシティ宮崎 1F アンジェラス (定員 63名)

(参加費) 無料 (但し、シンポジウム参加者はシンポジウム参加登録が必要です)

(参加登録) Eメール: yoichi.ose.zp@hitachi-hightech.com へお知らせ下さい。

締切: 2017年11月17日 (金) (定員63名. 定員に達し次第締切ります)

■第6回研究会プログラム

開会挨拶 (9:00-9:05)

(1) (9:05-9:40) 日本電子 沢田英敬氏

「高次幾何収差補正装置と色収差補正装置の開発」

(2) (9:40-10:15) 日立ハイテク ホックシャヘドウル氏

「N-SYLCによる収差補正の研究」

(3) (10:15-10:50) 日本電子 向井雅貴氏

「ダブルウイーンフィルタによる高分解能モノクロメータ」

(4) (10:50-11:25) 日立ハイテク 土肥英登氏

「SEM用マイクロミラー収差補正器の研究」

(5) (11:25-12:00) JFCC 川崎忠寛氏

「円環・円孔電極を用いた電界型・球面収差補正器の開発」

以上